

**ナノテクノロジープラットフォーム  
研究支援に提供する設備一覧  
【微細構造解析プラットフォーム】**

機関名	設備(設備群)名	仕様	備考
京都大学	極低温透過電子顕微鏡	日本電子社製JEM-2100F(G5) 加速電圧:200kV 冷却機能:ヘリウムクライオステージ	
京都大学	収差補正透過電子顕微鏡	日本電子社製JEM-2200FS 加速電圧:200kV 結像系球面収差補正装置 (CEOS社製)	
京都大学	モノクロメータ搭載低加速原子分解能分析電子顕微鏡	日本電子社製JEM-ARM200F 加速電圧:200kV, 60kV モノクロメータ:ダブルウィーンフィルター 球面収差補正装置(CEOS社製) エネルギーフィルター:Gatan966 QuantumERS EDX装置:JED-2300T SDD100GV(JEOL社製)	
京都大学	集束イオンビーム装置	日本電子社製JEM-9310FIB Gaイオン源 Gaイオンエネルギー:5~30 kV 最大電流10nA、分解能8nm	
京都大学	マイクローム	Leica社製ULTRA CUT UCT ステージ:クライオステージ、室温	
京都大学	精密イオン研磨装置	Gatan社製Model691/PIPS Arイオン源 0.1~5kV、低温ステージ	
京都大学	ディンプリング装置	South Bay Technology社製D500i	